U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

Y. NANJO et al.

Conf.:

UNKNOWN

Appl. No.:

10/645,598

Group:

UNKNOWN

Filed:

August 22, 2003

Examiner: UNKNOWN

For:

FIXING APPARATUS

LETTER

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

February 23, 2004

Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119 and 37 C.F.R. § 1.55(a), the applicant(s) hereby claim(s) the right of priority based on the following application(s):

Country	Application No.	<u>Filed</u>
JAPAN	2002-244208	August 23, 2002
JAPAN	2003-053342	February 28, 2003
JAPAN	2003-053368	February 28, 2003
JAPAN	2002-369242	December 20, 2002
JAPAN	2002-369245	December 20, 2002

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fee required under 37 C.F.R. §§ 1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH STEWART, KOLASCH

H) & BIROH, LLP

By_

errell C. Birch, #19,382

P.O. Box 747

TCB/pjh 2936-0195P Falls Church, VA 22040-0747

(703) 205-8000

Attachment(s)

(Rev. 02/12/2004)



10/645,598 f. 08/22/2003 1 %5 Buck, Stewart, tal. 703-205-8000 Docket # 2936-0195P

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月23日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-244208

[ST. 10/C]:

[JP2002-244208]

出 願 人
Applicant(s):

京セラミタ株式会社

2003年 8月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

【整理番号】 02-00669

【提出日】 平成14年 8月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03G 15/20

H05B 6/14

特許願

【発明の名称】 定着装置

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 大阪市中央区玉造1丁目2番28号 京セラミタ株式会

社内

【氏名】 南條 譲

【特許出願人】

【識別番号】 000006150

【住所又は居所】 大阪市中央区玉造1丁目2番28号

【氏名又は名称】 京セラミタ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100067828

【弁理士】

【氏名又は名称】 小谷 悦司

【選任した代理人】

【識別番号】 100075409

【弁理士】

【氏名又は名称】 植木 久一

【選任した代理人】

【識別番号】 100096150

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 孝夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 012472

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0001264

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 定着装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 強磁性体からなる支持体と、非磁性かつ導電性の材料からなり当該支持体に隣接して形成される薄膜状の発熱層とを具備した円筒状のヒートローラと、該ヒートローラの昇温用の励磁コイルとを備え、当該昇温用の励磁コイルに高周波電流を流して高周波磁界を生じさせ、前記発熱層に誘導渦電流を発生させてジュール熱により前記ヒートローラを昇温させることを特徴とする誘導加熱方式の定着装置。

【請求項2】 強磁性体からなる支持体と、非磁性かつ導電性材料からなり 当該支持体に隣接して形成される薄膜状の発熱層とを具備した無端状の定着用ベルトと、該定着用ベルトの昇温用の励磁コイルとを備え、

前記昇温用の励磁コイルに高周波電流を流して高周波磁界を生じさせ、前記発 熱層に誘導渦電流を発生させてジュール熱により前記ヒートローラを昇温させる ことを特徴とする誘導加熱方式の定着装置。

【請求項3】 前記発熱層は銅からなり、その層厚が約1μm~70μmの範囲 内であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の誘導加熱方式の定着装 置。

【請求項4】 前記発熱層はアルミニウムからなり、その層厚が約 $0.5 \mu m \sim 60 \mu m$ の範囲内であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の誘導熱方式の定着装置。

【請求項 5 】 前記発熱層はSUS304からなり、その層厚が約50 μ m~1000 μ m の範囲内であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の誘導熱方式の定着装置。

【請求項6】 前記支持体は鉄からなり、その層厚が約5μm~2000μmの範囲内であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の誘導加熱方式の定着装置。

【請求項7】 前記支持体はニッケルからなり、その層厚が約 5μ m~ 2000μ mの範囲内であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれかに記載の誘

導加熱方式の定着装置。

【請求項8】 前記発熱層の温度を検出するための温度検出手段が前記ヒートローラ内部に設けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の定着装置。

【請求項9】 前記発熱層を前記支持体の外周面に設けると共に、前記ヒートローラ又は定着用ベルトに圧接して配設される圧ローラの表面にも前記発熱層を設け、前記励磁コイルを前記ヒートローラ又は定着用ベルトの外側であって、 当該ヒートローラ又は定着用ベルト及び前記圧ローラの近接位置に配設したことを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の定着装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、用紙表面に付着したトナー像を用紙に定着させるために画像形成装置に備えられる定着装置に関し、特に、誘導加熱方式の定着装置に関する。

[00002]

【従来の技術】

従来から、コピー機等の画像形成装置に搭載される定着装置として、ウォームアップ時間削減及び加熱効率向上を図るために誘導加熱方式の定着装置が提案されている。この誘導加熱方式の定着装置は、ローラ内部に配設されたコイルに高周波電流を流して高周波磁界を生じさせ、強磁性体からなるローラの発熱層に誘導渦電流を発生させてジュール熱によりローラ自体を昇温させるものである。例えば、特開2000-268952号公報には、熱容量の小さいアルミ等の非磁性体の箔(約20μm程度)からなる発熱層と、2つの励磁コイルとを備え、この2つの励磁コイルは、磁気的に和動接続結合すると共に、これらの励磁コイルが励起する磁束が上記発熱層を貫通するように構成された定着装置が提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記公報に示される定着装置は2つの励磁コイルを必要とする ため、コスト高になると共に装置が大型化するという問題がある。その一方、当 該定着装置の発熱層を1つの励磁コイルで発熱させようとすると、当該発熱層が 薄肉のために電気抵抗が大きくなって渦電流の量が低下して加熱効率が悪くなる という問題があり、また、交番磁場発生源から漏れた磁界が装置周囲の他の金属 機器に悪影響を及ぼすなどの弊害が生じる可能性がある。

[0004]

本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、発熱層の加熱効率が良く、交番磁場発生源からの磁束の漏れが少ない定着装置であって、低コストかつ小型に構成することができる定着装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために請求項1に記載の発明は、強磁性体からなる支持体と、非磁性かつ導電性の材料からなり当該支持体に隣接して形成される薄膜状の発熱層とを具備した円筒状のヒートローラと、該ヒートローラの昇温用の励磁コイルとを備え、当該昇温用の励磁コイルに高周波電流を流して高周波磁界を生じさせ、前記発熱層に誘導渦電流を発生させてジュール熱により前記ヒートローラを昇温させることを特徴とする誘導加熱方式の定着装置である。

[0006]

また、請求項2に記載の発明は、強磁性体からなる支持体と、非磁性かつ導電性材料からなり当該支持体に隣接して形成される薄膜状の発熱層とを具備した無端状の定着用ベルトと、該定着用ベルトの昇温用の励磁コイルとを備え、

前記昇温用の励磁コイルに高周波電流を流して高周波磁界を生じさせ、前記発熱層に誘導渦電流を発生させてジュール熱により前記ヒートローラを昇温させることを特徴とする誘導加熱方式の定着装置である。

$[0\ 0\ 0\ 7\]$

また、請求項3に記載の発明は、請求項1又は請求項2に記載の誘導加熱方式の定着装置において、前記発熱層は銅からなり、その層厚を約 $1\mu m \sim 70\mu m$ の範囲内としたものである。

[0008]

また、請求項4に記載の発明は、請求項1又は請求項2に記載の誘導熱方式の

定着装置において、前記発熱層はアルミニウムからなり、その層厚を約 $0.5 \mu m$ ~ $60 \mu m$ の範囲内としたものである。

[0009]

また、請求項 5 に記載の発明は、請求項 1 又は請求項 2 に記載の誘導熱方式の 定着装置において、前記発熱層はSUS304からなり、その層厚を約 $50\,\mu\,\mathrm{m}\sim1000\,\mu\,\mathrm{m}$ の範囲内としたものである。

[0010]

また、請求項 6 に記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の誘導加熱方式の定着装置において、前記支持体は鉄からなり、その層厚を約 5μ m~ 2000μ mの範囲内としたものである。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

また、請求項 7 に記載の発明は、請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の誘導加熱方式の定着装置において、前記支持体はニッケルからなり、その層厚を約 $5\,\mu\,\mathrm{m}\sim2000\,\mu\,\mathrm{m}$ の範囲内としたものである。

[0012]

これらの構成によれば、発熱層が非磁性かつ導電性の薄膜であるので、当該発熱層を比較的低熱容量にして効率よく加熱することができることに加え、漏洩磁束は強磁性体の支持体に吸収されるので、磁場発生源から漏れた磁束が当該定着装置周囲の金属機器等に与える影響が少ない。

[0013]

これにより、特開2000-268952号公報に開示される従来の定着装置のように、 複数の励磁コイルの励起する磁束が発熱層を貫通するような構成を採る必要が無 くなるので、本発明に係る定着装置を低コストかつ小型に構成することができる

$[0\ 0\ 1\ 4]$

また、請求項8に記載の発明は、請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の定着装置において、前記発熱層の温度を検出するための温度検出手段が前記ヒートローラ内部に設けられているものである。

[0015]

この構成によれば、ヒートローラの記録紙ニップ部分に的確に温度検出手段を 設置することが可能となる。これにより、当該ニップ部分における正確な温度を 検出して的確な温度制御が可能になる。

[0016]

また、請求項9に記載の発明は、請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の定着装置において、前記発熱層を前記支持体の外周面に設けると共に、前記ヒートローラ又は定着用ベルトに圧接して配設される圧ローラの表面にも前記発熱層を設け、前記コイルを前記ヒートローラ又は定着用ベルトの外側であって、当該ヒートローラ又は定着用ベルト及び前記圧ローラの近接位置に配設したものである

$[0\ 0\ 1\ 7]$

この構成によれば、ヒートローラ又は定着用ベルトの外部に設けたコイルによって、ヒートローラ又は定着用ベルト及び圧ローラに設けられた両方の発熱層を加熱可能になるので、ヒートローラ又は定着用ベルト及び圧ローラの両方から記録紙を効率よく加熱することができ、記録紙に対するトナー層の定着性を更に向上させることができる。

$[0\ 0\ 1\ 8]$

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態に係る定着装置について図面を参照して説明する。図1は本発明に係る定着装置が搭載された画像形成装置の概略構成を示す模式図である。図1に示すように、プリンタ(画像形成装置の一例)1では、プリンタ本体2内にシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色用にそれぞれ現像装置3が備えられている。それぞれの現像装置3においては、a-Si(アモルファスシリコン)等からなる感光体ドラム4が備えられ、図中の矢印方向に回転するようになっている。この感光体ドラム4が帯電部5によって一様に帯電され、外部PC(パーソナルコンピュータ)等から入力された原稿画像データに基づくLED光が露光部(LEDプリントヘッドユニット等)6から感光体ドラム4の表面上に照射されて静電潜像が形成され、この静電潜像にトナーが付着してトナー像が形成される。このトナーの供給はトナー供給容器7C、7M、7Y、7Bか

6/

らそれぞれ行われる。これら各色用に感光体ドラム4が並設されている下方には 記録紙搬送ベルト8が配設されている。記録紙搬送ベルト8は転写ローラ9によ って各感光体ドラム4に押し付けられた状態とされ、不図示のモータ等によって 回転駆動される駆動ローラ10と、この駆動ローラ10によって無端回転される 記録紙搬送ベルト8に従って回転する従動ローラ11とによって感光体ドラム4 の回転方向の順方向に回転されるようになっている。

[0019]

そして、給紙機構12から記録紙搬送路13を経由して記録紙搬送ベルト8側に記録紙が搬送されていき、レジストローラ17によって各感光体ドラム4及び転写ローラ9等による画像転写動作と給紙動作のタイミングが調整される。当該タイミングの調整後、レジストローラ17が回転駆動されて記録紙が感光体ドラム4と記録紙搬送ベルト8との間に搬送される。記録紙が各感光体ドラム4と記録紙搬送ベルト8との間を搬送されていく間に、各感光体ドラム4表面の各色のトナー像が次々に記録紙に転写される。全ての感光体ドラム4からトナー像が転写された記録紙は、本発明に係る誘導加熱方式(IH方式)の定着装置14に搬送されてトナー像が定着され、カラー画像が形成される。この定着装置14の定着ローラ対を通過した記録紙は記録紙搬送路15に送られ、排出部16から排出される。なお、上記の各感光体ドラム4には、感光体ドラム4上の残留トナー等を除去するクリーニング機構20が備えられている。

[0020]

本発明に係る定着装置14について説明する。図2は本発明に係る定着装置の 概略構成を示す断面図であって、(a)はIHコイル25をヒートローラ141 の内部に配設した構成を示す図、(b)はIHコイル25をヒートローラ141 の外部に配設した構成を示す図、図3は当該ヒートローラの概略構成を示すため の部分断面図である。

[0021]

本発明に係る定着装置14は図2の矢印方向に回転するヒートローラ141及び圧ローラ142を備え、ヒートローラ141を誘導加熱方式(IH方式)で発熱させ、ヒートローラ141及び圧ローラ142のニップ部に搬送されてくる記

録紙をヒートローラ141から加熱して、記録紙上のトナー層を記録紙に定着させるものである。

[0022]

図2 (a) に示す定着装置14から説明する。ヒートローラ141は、強磁性体からなる円筒状の支持体141aからなり、支持体141aの内部空間にはIHコイル25が配設されている。支持体141aの内面側には、非磁性かつ導電性材料からなる薄膜状の発熱層141bが形成されている。更に発熱層141bの外面側には離形層141cが設けられている。ヒートローラ141の表面温度を検出するためのサーミスタ26は、離形層141cに当接させて設けられている。圧ローラ142はヒートローラ141に圧接された状態で設けられている。

[0023]

圧ローラ142は、弾力性を有する発泡性樹脂(スポンジ等)からなり、ヒートローラ141とのニップ部が一定幅を有し、この所定幅のニップ部において記録紙を押圧しながら、ヒートローラ141から加熱することによってトナー層を記録紙に定着させる。このように圧ローラ142を発泡性樹脂で形成することによって、更に低熱容量化を図ることができる。

[0024]

I Hコイル 2 5 は、ヒートローラ 1 4 1 の回転軸方向に螺旋状に巻かれたコイルからなる。 I Hコイル 2 5 に不図示の高周波電源等から高周波電流が流れると、それによって生じた高周波磁界によって発熱層 1 4 1 b に誘導渦電流が発生し、ジュール熱によりローラ自体が昇温するようになっている。

[0025]

発熱層 1 4 1 b は非磁性かつ導電性の金属で形成される(例えば、銅,アルミニウム, SUS304等)。発熱層 1 4 1 b の形成は、支持体 1 4 1 a の内周面に当該非磁性かつ導電性の材料をメッキ又は蒸着等することによって行われる。

[0026]

I Hコイル 2 5 の負荷として働く発熱層 1 4 1 b (被加熱体)は、その負荷が小さすぎると高周波電源の持つ内部抵抗等の影響を受けて加熱効率が悪化し、また、負荷が大きすぎると高周波電源の容量を越えてしまい充分に加熱できなくな

る。よって、発熱層 1 4 1 b の層厚(磁界浸透深さ)は以下に基づいて決定する。

上記磁界浸透深さ $\delta=\sqrt{(2/\mu\ \sigma\ \omega)}=\sqrt{(2\rho/\mu\ \omega)}=503\sqrt{(\rho/f\ \mu')}$

μ:透磁率 (H/m)

σ:導電率 (1/Ω·m)

ω:角振動数 (= 2 π f) (1/s e c)

f:周波数(Hz)

ρ:抵抗率 (Ω·m)

 μ ':比透磁率(= μ / μ 0)

周波数を約30kHzとした場合における発熱層141bの材質別の層厚と負荷の関係は図4に示す通りである。発熱層141bの層厚は、

銅(抵抗率 $1.67E-08(\Omega \cdot cm)$,比透磁率1)の場合は約 1μ m $\sim 70\mu$ mの範囲内、アルミニウム(抵抗率 $2.66E-08(\Omega \cdot cm)$,比透磁率1)の場合は約 0.5μ m $\sim 60\mu$ mの範囲内、

SUS304 (抵抗率7.20E-07(Ω ・cm), 比透磁率1) の場合は約50 μ m~1000 μ mの範囲内、であることが好ましい。

[0027]

なお、周波数を上げると(例えば、周波数約100kHz)、磁界浸透深さるが小さくなるため、発熱層 1 4 1 b の負荷が大きくなり層厚約1mm以上の銅やアルミニウムでも効率良く加熱できるようになる。

[0028]

これによれば、従来域の周波数(約20~100kHz)で発熱層 1 4 1 b を発熱させることが可能であるため、低ノイズかつ低コストで効率よく発熱層 1 4 1 b を発熱させることができる。

[0029]

支持体141aは強磁性体の金属(例えば、鉄,ニッケル等)で形成される。 支持体141aは、磁場発生源から漏れた磁束を吸収し、かつ、温度リップルを 抑制できる程度の大きな熱容量を有するように層厚が調整される。例えば、上記 発熱層141bの条件の場合、支持体141aとして、鉄を用いるときの層厚は 約 5μ m~ 2000μ mの範囲内、ニッケルを用いるときの層厚は約 5μ m~ 2000μ mの範囲内であることが好ましい。

[0030]

発熱層141bは、支持体141aとIHコイル25との間に介在するように 配設され、支持体141aの内面側に発熱層141bが設けられ、支持体141 aの外面側に離形層141cが設けられる。

[0031]

離形層141cは、記録紙及びトナー層に直接に接する部分であるため、その素材としてフッ素樹脂等が用いられ、ヒートローラ141から記録紙を剥離しやすいようにされている。

[0032]

なお、支持体141aの外周であって離形層141cの内側にシリコンゴム等の弾性部材を配設することによって、更に熱容量を確保すると共に、ヒートローラ141の表面に弾性力を付与するようにしてもよい。この場合、シリコンゴムの肉厚は約0.1mm以上とすることが好ましい。このようにシリコンゴムを配設すると、ヒートローラ141と圧ローラ142とのニップ部に記録紙が搬送されてきたとき、ヒートローラ141が弾性を持って記録紙に接することになり、記録紙上のトナー層との密着性が向上して画質が良くなるため、当該定着装置14をフルカラー印刷に適したものとすることができる。

[0033]

なお、鉄やニッケル等からなる支持体141aは、銅やアルミニウム等からなる発熱層141bよりも熱容量が大きいので、発熱層141bが急激な温度変化を生じないように抑制される。この支持体141aの熱容量を調整することによって、発熱層141bの温度リップル量を調節することも可能である。

[0034]

さらに、I Hコイル25がヒートローラ内部に配設されているため、ヒートローラ141の輻射熱がなくI Hコイル25の温度上昇が抑制される。また、ヒートローラ141内のI Hコイル25に対して冷却風を送る機構を容易に実現することが可能なので、I Hコイル25の温度上昇による不具合を防止できる。

[0035]

図2 (b) に示す定着装置14から説明する。図2 (b) に示すように、上記 I Hコイル25を、ヒートローラ141の表面に対向させるようにして、ヒートローラ141の外部に配設してもよい。この場合は、I Hコイル25をヒートローラ141及び圧ローラ142のニップ部近傍に配置することによって、ニップ 部近傍に回転移動してきた発熱層141b部分のみを効率よく加熱できる。

[0036]

なお、サーミスタ26に、応答性が確保された非接触型のものを用いると、ヒートローラ141表面の離形層141cとの間における摩擦をなくし、ヒートローラ141(離形層141c)の寿命を長持ちさせることができる。

[0037]

このようにIHコイル25をヒートローラ141の外部に配設する場合には、 支持体141aの外面側に発熱層141bを形成し、この発熱層141bの更に 外面側に離形層141cを形成する。この図2(b)に示す定着装置14におい ても、支持体141a及び発熱層141bの材質及び層厚は、上記図2(a)に 示す定着装置14の場合と同様である。

[0038]

このような構成でなる支持体141a及び発熱層141bを有するヒートローラ141によれば、発熱層141bが非磁性かつ導電性の薄膜であるので、当該発熱層141bは低熱容量であり効率よく加熱することができる。しかも、この発熱層141bを強磁性体の支持体141aに隣接させることによって、磁場発生源から漏れた磁束が支持体141aに吸収されるので、漏洩磁束が当該定着装置14の周囲の金属機器等に与える影響が少ない。

[0039]

また、上記定着装置 1 4 によれば、 I Hコイル 2 5 が発生する高周波磁界を集中させて加熱ポイントを絞ることができ、支持体 1 4 1 a にヨークのような働きを持たせることができるため、発熱層 1 4 1 b の加熱効率を向上させることができる。これにより、例えば、発熱層 1 4 1 b の内側及び外側に励磁コイルを配設し、発熱層 1 4 1 b に対して磁束を貫通させることによって発熱層 1 4 1 b を加

熱するような構成 (特開2000-268952号公報参照) を採らなくても十分に発熱層 141bを発熱させることができる。

[0040]

図5 (a) はIHコイル25をヒートローラ141の外部に配設すると共に、ローラ142の表面に発熱層142bを形成した構成を示す図、(b) はヒートローラ141の外部に2つのIHコイル25を配設した構成を示す図である。

[0041]

図5 (a) に示すように、I Hコイル25をヒートローラ141の外部に配設して、圧ローラ142の表面に発熱層142bを設けると、I Hコイル25によって圧ローラ142の発熱層142bも発熱させることができ、圧ローラ142側からも記録紙及びトナー層を加熱することができる。

[0042]

さらにサーミスタ26をヒートローラ141の内部に配設しているので、サーミスタ26の配設によってIHコイル25の配置が制約を受けることがなく、ヒートローラ141及び圧ローラ142のニップ部に相当する位置に的確にサーミスタ26を配置することが可能である。これにより、当該ニップ部における正確な温度を検出することができ、ヒートローラ141及び/又は圧ローラ142の正確な温度制御が可能になる。

$[0\ 0\ 4\ 3\]$

また、図5(b)に示すように、ヒートローラ141の発熱層141bと、圧ローラ142の発熱層142bとを、各々別個のIHコイル25で発熱させてもよい。この場合は、当該2つの発熱層141b,142bのそれぞれを的確に発熱させることができ、ヒートローラ141及び圧ローラ142のニップ部に搬送されてくる記録紙及びトナー層を更に確実に加熱することができる。

$[0\ 0\ 4\ 4]$

また、上記実施の形態では、本発明に係る定着装置14を、ヒートローラ14 1及び圧ローラ142からなる方式のものとしているが、本発明に係る定着装置 はベルト方式のものでも構わない。図6はベルト方式の定着装置の概略構成を模 式的に示す断面図である。なお、図面の簡略化のために定着用ベルトは実際より も短く図示している。ベルト方式の定着装置140は、図6の矢印方向に回転する無端状の定着用ベルト143と、これに圧接される圧ローラ142とのニップ部において、このニップ部に搬送されてくる記録紙及びトナー層を加熱することによって記録紙にトナー層を定着させるものであるが、この定着用ベルト143を支持体143a、発熱層143b及び離形層141cで構成する。

[0045]

この定着装置140では、発熱層143bは定着ベルト143の支持体143 a の内面側に設けられる。そして、定着用ベルト143の内側に複数のIHコイル250を配設する。例えば、これらIHコイル250は、定着用ベルト143 の回転方向に直交する方向(図6の奥行方向)に螺旋状に巻かれたコイルからなる。IHコイル250は、定着用ベルト143が長尺状であることに鑑みて複数設けられると共に、圧ローラ142とのニップ部の近傍に配設される。これにより、定着ベルト143の内部空間に設けられたIHコイル250が発生する高周波磁界を当該ニップ部に集中して加熱ポイントを絞り、発熱層143bの加熱効率を向上させる。離形層143cは支持体143aの外面側に設けられる。

[0046]

定着用ベルト143の内側であって、当該ニップ部の位置に相当する位置には サーミスタ26が配設されている。これにより、当該ニップ部における正確な温 度を検出して、定着用ベルト143(発熱層143b)の正確な温度制御を可能 にしている。

[0047]

また、この定着装置140においても、上記図2(b)及び図5(a)に示す構成と同様に、IHコイル25を定着用ベルト143の外側に設けてもよい。この場合、定着用ベルト143及び圧ローラ142の両方の発熱層を加熱することが可能になるので、定着用ベルト143及び圧ローラ142の両方から記録紙を効率よく加熱することができ、記録紙に対するトナー層の定着性を更に向上させることができる。

[0048]

なお、本発明は上記実施の形態の構成に限られず種々の変形が可能である。例

えば、支持体141a及び143aは上述したものに限られず、強磁性体であれば、上述したもの以外の素材を用いることも可能である。また、発熱層141b及び143bも上述したものに限られず、非磁性かつ導電性材料であれば、上述したもの以外の素材を用いることも可能である。

[0049]

【発明の効果】

以上のように請求項1乃至請求項7に記載の発明によれば、発熱層が非磁性かつ導電性の薄膜であるので、当該発熱層を比較的低熱容量にして効率よく加熱することができることに加え、漏洩磁束は強磁性体の支持体に吸収されるので、漏洩磁束が当該定着装置周囲の金属機器等に与える影響が少ない。

[0050]

これにより、特開2000-268952号公報に開示される従来の定着装置のように、 複数の励磁コイルの励起する磁束が発熱層を貫通するような構成を採る必要が無 くなるので、本発明に係る定着装置を低コストかつ小型に構成することができる

[0051]

また、請求項8に記載の発明によれば、発熱層の温度を検出するための温度検 出手段をヒートローラ内部に設けているので、ヒートローラの記録紙ニップ部分 に的確に温度検出手段を設置することが可能となる。これにより、当該ニップ部 における正確な温度を検出して的確な温度制御が可能になる。

[0052]

また、請求項9に記載の発明によれば、発熱層を支持体の外周面に設けると共に、ヒートローラ又は定着用ベルトに圧接して配設される圧ローラの表面にも発熱層を設け、コイルをヒートローラ又は定着用ベルトの外側であって、当該ヒートローラ又は定着用ベルト及び圧ローラの近接位置に配設し、ヒートローラ又は定着用ベルトの外部に設けたコイルによって、ヒートローラ又は定着用ベルト及び圧ローラに設けられた両方の発熱層を加熱可能になるので、ヒートローラ又は定着用ベルト及び圧ローラの両方から記録紙を効率よく加熱することができ、記録紙に対するトナー層の定着性を更に向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に係る定着装置が搭載された画像形成装置の概略構成を示す模式図である。

【図2】

本発明に係る定着装置の概略構成を示す断面図であり、(a)はIHコイルを ヒートローラの内部に配設した構成を示す図、(b)はIHコイルをヒートロー ラの外部に配設した構成を示す図である。

【図3】

支持体に強磁性体の金属を用いたヒートローラの概略構成を示すための部分断面図である。

【図4】

周波数を約30kHzとした場合における発熱層の材質別の層厚と負荷の関係を示す図である。

【図5】

(a) はサーミスタをヒートローラ内部に配設すると共に、I Hコイルをヒートローラの外部に配設した構成を示す図、(b) はサーミスタをヒートローラ内部に配設すると共に、I Hコイルをヒートローラの外部に2つの配設した構成を示す図である。

【図6】

本発明に係るベルト方式の定着装置の概略構成を模式的に示す断面図である。

【符号の説明】

14,140 定着装置

141 ヒートローラ

141a 支持体

141b 発熱層

141c 離形層

142 圧ローラ

1 4 2 b 発熱層

143 定着用ベルト

143a 支持体

1 4 3 b 発熱層

143c 離形層

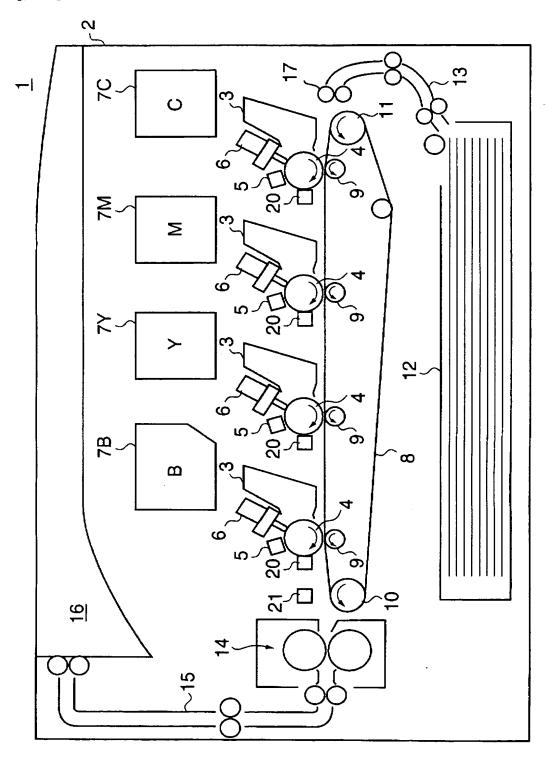
25, 250 IHコイル

26 サーミスタ

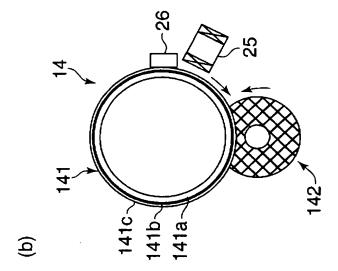
【書類名】

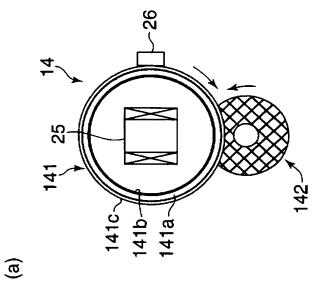
図面

【図1】

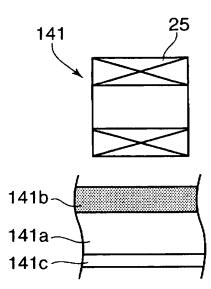




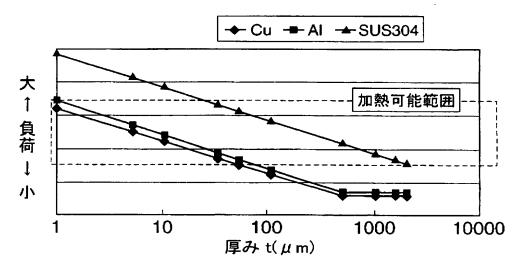




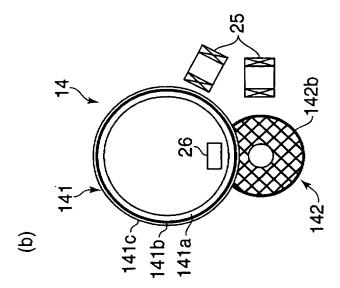


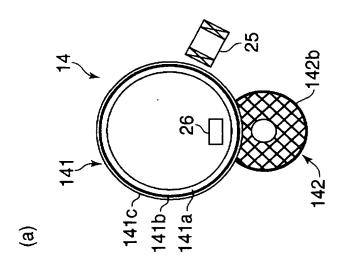


【図4】

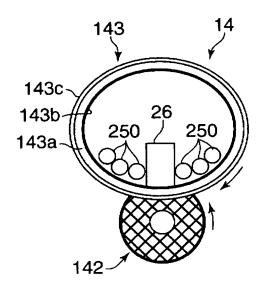








【図6】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 発熱層の加熱効率が良く、交番磁場発生源からの磁束の漏れが少ない 定着装置であって、低コストかつ小型に構成できる定着装置を提供する。

【解決手段】 強磁性体からなる支持体141aと、非磁性かつ導電性の材料からなり当該支持体141aに隣接して形成される薄膜状の発熱層141bとを具備した円筒状のヒートローラ141と、該ヒートローラ141の昇温用のIHコイル25とを備え、当該IHコイル25に高周波電流を流して高周波磁界を生じさせ、発熱層141bに誘導渦電流を発生させてジュール熱によりヒートローラ141を昇温させる。

【選択図】 図2

特願2002-244208

出願人履歴情報

識別番号

[000006150]

1. 変更年月日

2000年 1月31日

[変更理由]

名称変更

住所

大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号

氏 名 京セラミタ株式会社